PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-129919

(43)Date of publication of application: 16.05.1997

(51)Int.CI.

H01L 33/00 H01L 21/203

(21)Application number: 07-279967

(71)Applicant: NICHIA CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

27.10.1995

(72)Inventor: SANO MASAHIKO

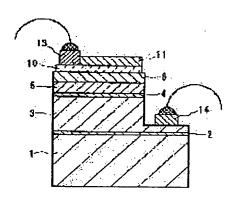
SENOO MASAYUKI NAKAMURA SHUJI

(54) NITRIDE SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a light emitting device having an excellent external quantum efficiency by forming an electrode constituted of a first layer composed of a light transmitting metallic thin film and a second layer composed of a transparent conductive film containing an oxide on the surface of a p-type nitride semiconductor layer.

SOLUTION: After Pd is vapor-deposited on almost the entire surface of a p-type GaN layer as a first layer 10, a second layer 11 composed of ITO is vapor-deposited on the first layer 10 and a light transmitting electrode is formed by alloying parts of the first p-layer 10 and second layer 11 in a state where the constituents of layers 10 and 11 are united together. Consequently, the electrode side can be constituted as an emitted light observing surface, because an electric current can be spread uniformly throughout the player and the p-layer can transmit light. Therefore, the light emitted from an active layer can be fetched effectively. Moreover, since



the electrode has an excellent ohmic property against the p-layer, in addition, a practical light emitting device having a low Vf can be obtained.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-129919

(43)公開日 平成9年(1997)5月16日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H01L	33/00			H01L	33/00	С	
						E	
	21/203				21/203	M	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

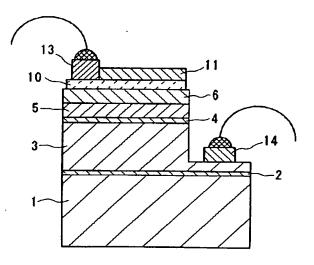
		番金朝求	未開求 開求項の数4 〇L (全 6 頁)
(21)出願番号	特願平7-279967	(71)出願人	000226057 日亜化学工業株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)10月27日		徳島県阿南市上中町岡491番地100
		(72)発明者	佐野 雅彦 徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化 学工業株式会社内
		(72)発明者	妹尾 雅之 徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化 学工業株式会社内
		(72)発明者	中村 修二 徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化 学工業株式会社内

(54) 【発明の名称】 窒化物半導体発光索子

(57)【要約】

【目的】 発光素子として有用なp層の新規な電極を提供することにより、外部量子効率に優れた発光素子得る。

【構成】 p型窒化物半導体層が最表面に形成されてなる窒化物半導体発光素子において、前記p型窒化物半導体層の表面に、透光性の金属薄膜よりなる第一の層と、酸化物を含む透明導電膜よりなる第二の層とからなる電極が形成されているので、透光性の電極を通して発光が観測でき、外部量子効率が向上する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 p型窒化物半導体層が最表面に形成され てなる窒化物半導体発光素子において、前記p型窒化物 半導体層の表面に、透光性の金属薄膜よりなる第一の層 と、酸化物を含む透明導電膜よりなる第二の層とからな る電極が形成されていることを特徴とする窒化物半導体 発光素子。

【請求項2】 前記第一の層の膜厚が500オングスト ローム以下であることを特徴とする請求項1に記載の窒 化物半導体発光素子。

【請求項3】 前記第一の層がニッケル(Ni)、白金 (Pt) パラジウム (Pd)、ロジウム (Rh)、ルテ ニウム (Ru)、オスミウム (Os)、イリジウム (1 r)よりなる群から選択された少なくとも一種を含む金 属または合金よりなることを特徴とする請求項1または 請求項2 に記載の窒化物半導体発光素子。

【請求項4】 前記第二の層が亜鉛(Zn)、インジウ ム(In)、スズ(Sn)、マグネシウム(Mg)より なる群から選択された少なくとも一種を含む酸化物より なることを特徴とする請求項1乃至請求項3の内のいず 20 れか一項に記載の窒化物半導体発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は窒化物半導体(InxA 1, G a, -x - y N、0 ≤ X、0 ≤ Y、X+Y≤ 1) が積層され てなるLED等の発光素子に係り、特に最表面にp型窒 化物半導体層が形成された発光素子の電極に関する。 [0002]

【従来の技術】現在、窒化物半導体(InxAlvGa 1-x-v N、0≦X、0≦Y、X+Y≦1)を用いた青色LE D、緑色LEDが実用化されている。これらのLEDの 基本的な構造は、透明な絶縁性基板の上に例えばn型A 1,Ga₁₋,N(0≤Y≤1)よりなるn型窒化物半導体 層(以下、n層という。)と、InxGa1-xN(0<X ≦1)よりなる活性層と、p型Al,Ga,-,N(0≦Z ≦1)よりなるp型窒化物半導体層(以下、p層とい う。) とが順に積層されたダブルヘテロ構造を有してい る。このLEDは基板側からn電極を取り出すことがで きないので、同一面側からn電極と、p電極とを取り出 す、いわゆるフリップチップ形式とされている。発光観 40 の層の透光性が非常に良くなる。 測面側は基板が透明であるので、基板側、電極側いずれ 側にもなるが、電極側、つまりp型窒化物半導体層側が 発光観測面とされているものが多い。

【0003】発光観測面側となるp層には、活性層の発 光を外部に取り出すために透光性の金属よりなる電極が 設けられている。また我々は特開平6-314822号 公報において、p層の表面に透光性の金属電極が設けら れた発光素子を示した。しかしながら、従来の透光性の 金属電極では、青色、緑色光に対する電極の透過率が悪 った。

【0004】ところで、LED等の半導体材料よりなる 発光索子に使用される電極は、順方向電圧を低下させる ためにも、その半導体材料と好ましいオーミック接触を 得ている必要がある。前記LEDにおいても、n層には TiとAlを含む電極、p層にはNiとAuを含む電極 で好ましいオーミック接触を得ている。

【0005】その他、窒化物半導体に形成する電極材料 として、例えば特開平5-55631号には酸化スズ、 酸化インジウム、酸化亜鉛が示されている。しかしこの 10 公報に示される材料はアクセプター不純物をドープした i (insulater)型の窒化物半導体に形成する電極であっ て、好ましいオーミックは得られておらず、p層に形成 する電極ではない。また特開平5-315647号公報 にはp層に形成する好ましい電極としてAg、Au、P t、Ir、Pd、Rh等が述べられているが、実際には p型ではなくMIS構造の発光素子の i 層にAu電極し か設けられていない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】p層は従来より結晶成 長が非常に難しい材料であり、その物性も未だ良く解明 されていないのが現実である。p-n接合を有するLE Dが実現されてもp層に形成する電極には未だ改良すべ き点も多く、さらにp層となじみが良く、数々の特性に 優れた電極材料が求められている。またLEDでは外部 量子効率の向上が望まれている。従って本発明の目的と するところは、発光素子として有用なり層の新規な電極 を提供することにより、外部量子効率に優れた発光素子 を実現することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の発光素子は、p 型窒化物半導体層が最表面に積層されてなる窒化物半導 体発光素子において、前記 p型窒化物半導体層の表面 に、透光性の金属薄膜よりなる第一の層と、酸化物を含 む透明導電膜よりなる第二の層とからなる電極が形成さ れていることを特徴とする。

【0008】さらに本発明の態様では、第一の層の膜厚 が500オングストローム以下であることを特徴とす る。500オングストローム以下の膜厚にすれば、第一

【0009】また、第一の層がニッケル(Ni)、白金 (Pt) パラジウム (Pd)、ロジウム (Rh)、ルテ ニウム(Ru)、オスミウム(Os)、イリジウム(1 r)よりなる群から選択された少なくとも一種を含む金 属または合金よりなることを特徴とする。これらの金属 または合金はp型層と好ましいオーミック接触が得ら れ、その中でも特に第一の層において、Niおよび/ま たはPdをp層と接する側にすると、さらに好ましいオ ーミック接触を得ることができる。

く、外部量子効率では未だ十分満足できるものではなか 50 【0010】また、本発明では、第二の層が亜鉛(2

n)、インジウム(In)、スズ(Sn)、マグネシウ ム (Mg) よりなる群から選択された少なくとも一種を 含む酸化物よりなることを特徴とする。具体的にはZn O、In,O,、SnO,、ITO(InとSnとの酸化 物)、MgO等を挙げることができる。

【0011】本発明の発光素子において、第一の層、お よび第二の層を形成するには蒸着、スパッタ等、通常の 気相製膜装置を用いることができる。第一の層は透光性 の金属薄膜である。金属薄膜を透光性にするには例えば 金属薄膜の膜厚の制御により可能である。透光性になる 10 膜厚は金属の種類によっても異なるが、通常 0. 1 μ m 以下の膜厚にすることにより透光性とすることができ る。好ましくは500オングストローム (0.05μ) m)以下、さらに好ましくは200オングストローム以 下の膜厚にすることにより、第一の層が発光の吸収が少 ない優れた透光性を有する。なお透光性とは発光素子の 発光波長を電極が透過するという意味であって、必ずし も無色透明を意味するものではない。

【0012】第一の層はp層の電極となる金属で透光性 の薄膜を形成できる材料であればどのような材料でも良 20 いが、特にNi、Pt、Pd、Rh、Ru、Os、Ir よりなる群から選択された少なくとも一種を含む金属ま たは合金はp層と好ましいオーミック接触が得られ、発 光素子の順方向電圧を下げる上で有用である。、その中 でも特に、Niおよび/またはPdをp層と接する側に すると、窒化物半導体よりなる発光素子の360nm~ 650nm付近、望ましくは380nm~560nmの 波長の吸収が少なく、かつオーミック性にも優れている ので、最も好ましい。またこの第一層を前記金属の積層 構造としてもよい。積層構造の場合、後に電極を熱的ア ニールで処理すると、電極材料が第一層の中で渾然一体 となって合金化した状態となる。

【0013】第二の層は第一の層の上に形成して、電極 全体の抵抗を低くする。そのために第二の層を酸化物を 含む透明導電膜とする。酸化物を含む透明導電膜には数 々の種類があるが、特に好ましくはZnO、In,O,、 SnOz、ITO (InとSnの酸化物)、MgO等で 示されるZn、In、Sn、Mg等の酸化物を含む抵抗 の低い透明導電膜を形成することが望ましい。この透明 導電膜よりなる第二の層の厚さは特に限定するものでは 40 性電極。 なく、数オングストローム~数 µ mの厚さで形成可能で ある。

【0014】本発明の発光素子はMOVPE(有機金属 気相成長法)、HDVPE(ハライド気相成長法)、M BE(分子線気相成長法)、MOMBE(有機金属分子 線気相成長法)等の気相成長装置を用いて、基板上に窒 化物半導体の結晶を成長、積層することで作成可能であ る。基板にはサファイア(AI、O、)、ZnO、スピネ ル (MgAl,O,)、SiC、Si、GaN等が用いら れるが、一般的にはサファイア、SiCが用いられると 50 なオーミック接触を示している。この傾向は第二層目を

とが多い。積層構造としては、基本的にη層の上にρ層 を積層してp層が最表面となるように積層して、との最 表面のp層に電極を形成できる構造とする。具体的には p-n接合を有するヘテロ構造、p-i-n接合を有す るヘテロ接合の発光素子等が挙げられる。n型の窒化物 半導体は、例えばSi、Ge、Se等のドナー不純物を ドープすれば成長可能である。一方、p型の窒化物半導 体は、Mg、Zn等のII族元素、C等のアクセプター不 純物を窒化物半導体中にドープすることにより成長可能 である。例えば、MOVPE法を用いてアクセプター不 純物をドープした窒化物半導体を成長させると、成長 後、何の処理をしなくともp型特性を示すものもある が、好ましくは、400℃以上でアニーリング処理を施 すことにより、さらに好ましいり型特性を示すようにな る。なおp型とは、例えばアクセプター不純物をドープ した窒化物半導体で、抵抗率が10°Ω・cm以下を示す 半導体をいう。

[0015]

【作用】図1はp層に形成した各種電極の電流電圧特性 を示すグラフである。具体的に、p層の上に次に述べる 第一の層のみを形成した後、あるいは第一の層と第二の 層とを形成した後、400°C以上でアニールして電極を 形成し、同一種類の電極同士の電流電圧特性を測定する ことにより、その電極のp層に対するオーミック性を調 べたものである。また、図2は図1に示す透光性電極の 透過率を示すグラフである。電極は次の通りである。 [0016]

A:第一の層にPdを40オングストロームの膜厚で形 成した透光性電極。

B:第一の層にRhを40オングストロームの膜厚で形 成した透光性電極

C:第一の層にPdを10オングストローム、第二の層 にZnOを500オングストロームの膜厚で形成した透 光性電極。

D:第一の層にPdを10オングストローム、第二の層 に I n, O, を500オングストロームの膜厚で形成した 透光性電極。

E:第一の層にNiを60オングストローム、第二の層 にAuを200オングストロームの膜厚で形成した透光

【0017】図1に示すように、Pd (A)はp層と接 する側にすると非常に良好なオーミック性を示す。なお A線の傾きはPdの膜厚が薄くなればなるほど、小さく なる傾向にある。一方、Rh(B)は一応オーミック性 は示すものの、他のA、CD、Eに比べて接触抵抗が大 きい。なお他のRu、Os、Ir等の白金族の元素はB 線と同様の傾向を示したので省略する。次に一層目にP d、二層目にZnOを形成した電極(C)、及び一層目 にPd、二層目にIn,O,を形成した電極(D)も良好

ITO、SnOzまたはMgOとしても同様であったの で省略する。また一層目にNi、二層目にAuを形成し た電極(E)は良好なオーミック接触を示しているが透 過率が悪い。これは後に述べる。なおオーミック性に関 しては第一層目にNi、Ptを形成した電極もE線と同 様の傾向を示したので省略する。

【0018】また図2は各電極の透過率を示すものであ るが、従来のNi-Auを含む電極(E)は窒化物半導 体発光素子の発光の特徴である紫色〜緑色領域にかけて の透過率が悪い。これに対し、本発明の発光素子に係る 10 電極C、Dの透過率はEに比べて非常に優れているの で、発光素子の外部量子効率を向上させることができ る。また、第一層目にのみ他の白金族の元素Pt、R u、Os、1r等の元素よりなる透光性電極はA, B線 と類似した透過率を示すので省略する。

【0019】p層を最表面とする発光素子では、p層に 形成した電極が発光をさえぎらなければ、発光素子の外 部量子効率が向上する。そとで、p層の表面に、透過率 のよい透光性の金属薄膜よりなる第一の層と、透過率の 良い酸化物を含む透明導電膜よりなる第二の層とからな 20 る電極を形成することにより、発光素子の外部量子効率 は向上する。

【0020】さらに、第一の層の膜厚が500オングス トローム以下であると、透光性の良い電極としての第一 の層を形成することができるが、第一の層の膜厚を次第 に薄くすることにより、電極のp層に対するシーズ抵抗 が大きくなる傾向にある。本発明では透明な導電膜であ る第二の層を、第一の層の上に形成していることによ り、全体としての電極の厚さが厚くなって、抵抗が大き くなるのを防止できる。しかも、電極全体としては透光 30 性を保ったままであるので、発光は効率よく外部へ取り 出される。

【0021】さらに、第一の層にNi、Pt、Pd、R h、Ru、Os、Irよりなる群から選択された少なく とも一種を含む金属または合金とすることにより、膜厚 を薄くした状態においてもp層と好ましいオーミックが 得られるために、発光素子のVfが下がり、発光効率に 優れた素子を実現できる。また窒化物半導体発光素子が 特徴とする紫~緑色波長域での透過率がよい。

【0022】また、第二の層にZn、In、Sn、Mg よりなる群から選択された少なくとも一種を含む導電性 の酸化物薄膜は前記のように紫~緑色波長域での透過率 が良く、さらに、第一の層の膜厚を薄くしても、この第 二の層があるために電極の抵抗が上がらないという利点 を有する。

[0023]

【実施例】以下、図面を基に本発明の発光素子の一実施 例について説明する。 図3は本発明の発光素子をp層の 電極側から見た平面図であり、図4は図3の発光素子を

面図である。

【0024】[実施例1] MOVPE反応装置を用い、 2 インチφのサファイア基板 1 の上にGaNよりなるバ ッファ層2を200オングストローム、Siドープn型 GaNよりなるn型コンタクト層3を4μm、ノンドー プIn0.2G a 0.8Nよりなる単一量子井戸構造の活性層 4を30オングストローム、Mgドープp型Al0.1G a 0.9Nよりなるp型クラッド層5を0.2 μm、Mg ドープp型GaNよりなるp型コンタクト層6を0.5 μmの膜厚で順に成長させる。

6

【0025】さらにウェーハーを反応容器内において、 窒素雰囲気中で600℃でアニーリングして、p層5、 6をさらに低抵抗化する。アニーリング後、ウェーハを 反応容器から取り出し、最上層の p 型 G a N の表面に所 定の形状のマスクを形成し、エッチング装置でマスクの 上からエッチングを行い、図2に示すようにn型コンタ クト層3の一部を露出させる。

【0026】次に、p層の上のマスクを除去し、最上層 のp型GaN層のほぼ全面に第一の層10として、Pd を20オングストロームの膜厚で蒸着する。蒸着後の第 一の層は明らかに透光性となっており、サファイア基板 1まで透けて観測できた。このように第一の層を、露出 したp層のほぼ全面に形成することにより、電流をp層 全体に均一に広げることができ、しかも透光性であるの で、電極側を発光観測面とできる。

【0027】第一の層10形成後、第一の層の隅部にA uとNiを含むボンディング用のパッド電極13を2μ mの膜厚で形成する。なおこのパッド電極13は透光性 ではない。

【0028】パッド電極13形成後、第一の層10の上 にITOよりなる第二の層11を500オングストロー ムの膜厚で蒸着する。

【0029】パッド電極13を形成した後、露出したn 層にTiとAlとを含むn電極l4を2μmの膜厚で形 成し、最後にアニール装置で400℃以上で熱処理を施 し、電極を合金化させる。なおアニールにより p 層の第 一の層10と第二の層11とからなる透光性の電極は合 金化して渾然一体となった状態となっているので、図1 では、あえて最表面の電極を第二の層11と示さず、第 40 一の層+第二の層という意味で10+11という符号で 示している。

【0030】以上のようにして、n型コンタクト層3と p層コンタクト層6とに電極を形成したウェーハを、3 50μm角のチップ状に切断し、その発光チップのサフ ァイア基板側1をリードフレームと接着し、ワイヤーボ ンドし、エポキシ樹脂でモールドしてLED素子とした ところ、If(順方向電流)20mAにおいて、Vf (順方向電圧) 3. 4 V、発光波長460 n m であり、 発光出力は、従来のNiとAuを含む透光性のp電極を 図に示す一点鎖線で切断した際の構造を示す模式的な断 50 有する同構造のLEDよりも、約30%高かった。

【0031】[実施例2]実施例1において、第一の層 10にNiを20オングストローム、第二の層11にI n,O,を500オングストロームの膜厚で形成する他 は、実施例1と同様にしてLED素子を得たところ、1 f20mAにおいて、Vf3.5Vで発光出力は実施例 1のものとほぼ同等であった。

【0032】[実施例3]実施例1において、第一の層 10にPdを10オングストローム、Niを10オング ストローム積層し、第二の層11にSnOzを用いる他 20mAにおいて、Vf3.4V、発光出力も実施例1 のものとほぼ同等であった。

【0033】 [実施例4] 実施例1において、第一の層 10にPdを10オングストローム、Ptを10オング ストローム積層し、第二の層11に2n0を用いる他は 実施例1と同様にしてLED素子を得たところ、1f2 0mAにおいて、Vf3.5V、発光出力も実施例1の ものとほぼ同等であった。

【0034】 [実施例5] 実施例1において、第一の層 10にPdを10オングストローム、Rhを10オング 20 を示す平面図。 ストローム積層し、第二の層11にMgOを用いる他は 実施例1と同様にしてLED素子を得たところ、If2 0mAにおいて、Vf3.5V、発光出力も実施例1の ものとほぼ同等であった。

【0035】 [実施例6] 実施例1において、第一の層 10にPdを10オングストローム、Ruを10オング ストローム積層し、第二の層11に1n,〇,を用いる他 は実施例1と同様にしてLED素子を得たところ、If 20mAにおいて、Vf3.5V、発光出力も実施例1 のものとほぼ同等であった。

【0036】[実施例7]実施例1において、第一の層 10の膜厚を200オングストロームとする他は実施例* * 1 と同様にして、LED素子を得たところ、 If 20 m Aにおいて、Vf3.4Vであったが、第一の層の透光 性がやや失われたため、発光出力は実施例1のものに比 べて20%程低下した。

[0037]

【発明の効果】以上説明したように本発明の発光素子 は、p層の表面に形成して、活性層の発光を有効に外部 に取り出すことができる。しかも電極がp層とのオーミ ック性にも優れているため、Vfが低い実用的な発光素 は実施例 1 と同様にしてLED素子を得たところ、If 10 子を実現できる。本発明の発光素子を例えばフルカラー LEDディスプレイ、LED信号機、道路情報表示板等 のLEDデバイスに使用すると、低消費電力で明るいデ バイスが実現でき、その産業上の利用価値は大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 p層に形成した各種電極の電流電圧特性を示 す図。

【図2】 p層に形成する各種電極の各波長に対する透 過率を示す図。

【図3】 本発明の一実施例に係る発光素子の電極形状

【図4】 図1の発光素子の構造を示す模式断面図 【符号の説明】

1・・・・サファイア基板

2・・・・バッファ層

3····n型コンタクト層

4・・・・活性層

5···・p型クラッド層

6···・p型コンタクト層

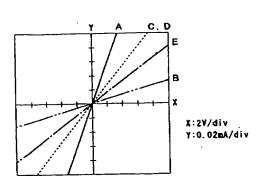
10・・・第一の層

11・・・・第二の層

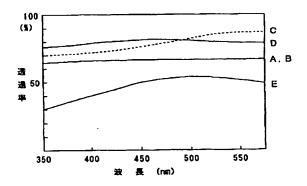
13・・・・パッド電極

14 · · · · n 電極

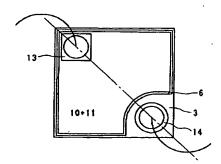
【図1】



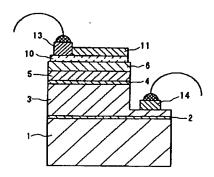
【図2】



[図3]



【図4】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:					
☐ BLACK BORDERS					
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES					
FADED TEXT OR DRAWING					
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING					
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES					
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS					
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS					
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT					
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY					
OTHER:					

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.